

三次元組織解析の最前線 後編

放射光を使った X 線 CT による 3D 観察

上杉健太朗1 星 野 真 人2 竹 内 晃 久2

1. はじめに

X線CT法は被写体の内部構造を可視化する手法であり, Hounsfieldによる医療診断用X線CTスキャナーの開発⁽¹⁾ から医療診断分野を中心として広く使われている.X線CT 法の特長は内部の三次元情報すなわちX線吸収係数の分布 を非破壊かつ定量的に計測出来ることである.

材料科学などの分野における要求として高空間分解能 X 線 CT 撮影があり、2000年ごろからラボ用装置も放射光 X 線を利用した装置も急激に高空間分解能化が進んだ. 2000 年ごろはせいぜい 3-5 µm 程度だった空間分解能は、本稿執 筆時点ではラボ用装置⁽²⁾⁻⁽⁴⁾も1µm以下の空間分解能に到 達しているし、放射光施設特有のX線顕微鏡光学系を利用 した装置では 100 nm 以下という値も珍しくない⁽⁵⁾⁻⁽⁷⁾.X 線 CT 装置の開発自体,国内はもちろん世界中の放射光施設 において行なわれている⁽⁸⁾⁽⁹⁾. それぞれの施設あるいは担当 者の特徴を活かした装置が稼働しており、生物・材料等様々 な研究分野での利用が進んでいる.X線CT計測において放 射光 X線を使う理由は、その圧倒的な単色性と光束密度を 生かし、空間・時間・密度(コントラスト)の各分解能を上げ ていくことである. また, CT 計測の可能性を拡げるという 意味では、高エネルギーX線の利用は欠かせなくなってき ている. 例えば単純な投影型では X 線光学系の改良や画像 検出器の改良が進み, ESRF や SPring-8 を中心に 100 keV 以上での計測の重要性が認知されてきている.

本稿では大型放射光施設 SPring-8 における,X線 CT 計測の最近の進展とこれからの課題について述べる.

2. 最近の進展

 X 線顕微鏡光学系を利用した X 線ナノ CT・マルチス ケール CT

(a) X 線ナノ CT

顕微的目的で用いられる X 線 CT は,およそ 1 µm の空間 分解能を境界に2つに大別される.投影光学系をベースと した X 線マイクロ CT (図 1)は約 1 µm 以上の構造を捉える ことができ,それより細かい構造を観察するためには X 線 顕微鏡技術と組み合わせた X 線ナノ CT が用いられる.メ ゾスコピックとよばれるナノ〜ミクロンの構造領域は,電顕 と光顕がカバーする領域の間にあることから多くの分野(材



図1 放射光 X線マイクロ CT 装置の模式図. (オンラインカラー)

* 公益財団法人高輝度光科学研究センター;1)主席研究員 2)主幹研究員(〒679-5198 兵庫県佐用郡佐用町光都 1-1-1) 3-D Observation with Synchrotron Radiation X-ray CT.; Kentaro Uesugi*, Masato Hoshino and Akihisa Takeuchi(*Japan Synchrotron Radiation Research Institute, Sayo-gun, Hyogo) Keywords: *synchrotron radiation, x-ray, micro-tomography* 料科学,地球惑星科学,電池・デバイス)において未知の領域となっている.X線ナノCTはこの領域の3次元構造を非破壊で観察することができる装置として期待されている.現状の3次元構造計測の実用レベルの空間分解能は100 nm 前後であるが⁽¹⁰⁾⁽¹¹⁾,これが数十 nm に達すればこの領域は完全にカバーできる.

X線ナノCTのベースとして用いられるX線顕微鏡は、 様々な技術が提案・開発されてきた.集光ビームを走査プロ ーブとして用いる走査型X線顕微鏡や、X線用の対物素子 を像拡大用の結像素子として用いる結像型X線顕微鏡,さ らに高コヒーレンス光を利用したホログラフィや coherent diffraction imaging (CDI),あるいはその技術を応用した ptychography が急速に発展してきた.これらは、それぞれ 特徴を持つが、中でも結像型X線顕微鏡は単位時間辺り得 られるデータ量が最も大きく、光源に要求される性能も他と 比べて少ないことから、放射光だけでなく実験室系において も利用されている.特に大強度X線が利用できる放射光施 設においては様々な状況下での測定やその場観察等の利用も 広がっている.

ここでは、SPring-8 BL20XU, BL37XU, BL47XU で共用 利用されている結像型 X 線顕微鏡をベースとした X 線ナノ CT を紹介する. 概略図を図2に示す. 光学系は基本的に光 学顕微鏡のそれと同じである. コンデンサにより試料面上直 径 50~100 µm 程度の領域を均一に集光照射し, 試料を透過 した X線は X線対物素子で拡大され,X線画像検出器の検 出面上で結像される.ただし,X線の屈折率はあらゆる物 質に対してほとんど1であるため,可視光領域で用いられ るレンズのような屈折型、反射型の素子は、そのままでは X線領域では対物素子として有効に機能しない.X線領域 に特化した様々なX線光学素子が開発されているが,ここ では、フレネルゾーンプレート(Fresnel zone plate, FZP, NTT Advance Technology)と呼ばれる, X線の回折を利用 するタイプの素子を対物素子として用いている.検出器に は、レンズカップル式可視光変換モジュールを取り付けた 16bit sCMOS(ORCA Flash 4.0, 浜松ホトニクス)カメラを 利用しており、測定時の実効画素サイズは 30~50 nm 程度 である.ナノオーダーのCT計測を可能とするために,試料 の回転ステージにはスライドガイド軸受け式回転ステージ (神津精機)を用いており、軸ブレ精度は100 nm 程度であ る. 光学素子製作の技術的困難さから, エネルギー領域は



 図2
 X線顕微鏡光学系を利用したX線ナノCT装置の模式

 図.(オンラインカラー)

10 keV 程度あるいはそれ以下での利用に長年限られてきた が,近年数十 keV の高エネルギー利用も可能になってき た⁽¹¹⁾⁽¹²⁾.

X線の回折を利用する FZP の場合,X線のエネルギーに よって焦点距離が変わるため,結像顕微鏡光学系として必要 な鏡筒長もエネルギーによって異なる. 鏡筒長7mの BL47XU, 27mのBL37XUは主に6~15keVのエネルギ ー領域で, 鏡筒長 165 m に達する BL20XU では 15~37.7 keV のエネルギー領域に対応する.これらの装置の空間分 解能は実測で 50-100 nm (half-pitch)である⁽¹⁰⁾⁽¹¹⁾. また, 通常の吸収コントラストに加え, ゼルニケ型位相コントラス ト法による高感度計測も可能である. 一般的な CT 測定時間 は、BL47XUでは7.5分(露光 0.25 s/frame, 1800投影), BL20XU では15分~30分(0.5~1 s/frame×1800投影)であ るが、露光時間や投影数を減らすことで高速計測も可能であ る. 測定例として、小惑星探査機はやぶさが持ち帰った、小 惑星イトカワの微粒子の CT 像を図3 に示す.鉄の吸収端を 挟む7keVと8keV2つのX線エネルギーで吸収係数の定 量測定をすることによって、鉱物の3次元分布の精細なマ ッピングに成功している. この CT データから, イトカワは 地球上で見つかる LL4-6 普通コンドライトと呼ばれる隕石 と同じような鉱物組成を持っているということが示され $c^{(13)}$.

(b) マルチスケール CT

「できるだけ試料をこわさず,できるだけ大きいものを, できるだけ高い解像度で観察したい」というのは,普遍的か つ究極の目標の一つといえよう.分解能と視野を段階的に切 り替えるマルチスケールイメージングはこの要求に答える測 定技術の一つといえる.光学顕微鏡では対物レンズを交換す るなど,マルチスケールイメージングは確立された技術とし て容易に利用されている.しかし,物体内部を観察する 3D イメージングでは,このような測定を非破壊で行うことは容 易ではない.なぜなら,対象物は視野に対して平面的に大き いだけではなく,光軸方向にも大きな厚みを持つからであ る.このような状況では,プローブ光には,大きな物体を透 過させるための高い透過力と,微細構造による微小なコント ラスト変動を検出するための物質との高い相互作用という,



図3 小惑星探査機はやぶさによりもたらされた小惑星イトカ ワの微小試料の鉱物の3次元分布像.(オンラインカラー)

相反する特性が求められる.この要求に応えるために,X 線マイクロCTと高エネルギーX線位相差ナノCTを組み 合わせたX線マルチスケールCTシステムが開発され た⁽¹¹⁾⁽¹²⁾. これは前述したように,近年 20 keV 以上の高エ ネルギーX線に対応可能になったことで実現した技術であ る. 高い透過力を持つ高エネルギーX線を使えるようにな ればより多くの物質を破壊せずにそのメゾスコピック領域の 「生きた」構造観察,つまり3次元でなく4次元あるいはそ れ以上の観察が可能になり、材料の真の理解につながる. SPring-8ではBL20XU, BL47XUでこのマルチスケール CT が実施されている.実験装置は、広視野・低解像度イメ ージング用のマイクロ CT(図1)と、狭視野・高解像度イメ ージング用のナノCT(図2)の組み合わせで構成されてい る. マイクロ CT で試料全体を撮影し, 試料をステージから 取り外すことなくナノCT でその関心領域(region of interest, ROI)を精密に計測する. 両者の測定モードは, 専用 ソフトウエア上で簡単に切り替えることができる.ナノCT モードでは巨大な試料の微細構造を感度良く計測するために, X線位相コントラスト法による高感度計測が導入されてい る.本システムは、大きな物体の内部をナノメートルスケー ルで非破壊的に 3D イメージングできるという利点に加え, マイクロ CT 計測を組み合わせることでミリサイズの試料を 扱えることから、試験機も導入しやすく、時分割、in-situ、 ex-situ, operando などの 4D-CT 観察がより容易に実施で きるようになった.

測定例として、チタン合金 Ti-6Al-4V の内部起点の疲労 き裂を非破壊で観察した例を図4に示す.チタン合金は、そ の優れた機械的特性から航空機材料等にも広く使われている が、107 回を超える非常に高いサイクルの負荷がかかると内 部疲労破壊を起こすという問題があり、この亀裂の発生と成 長のメカニズムの理解が急務となっている⁽¹⁴⁾.実験ではま ず、直径 0.45 mm の試料(図4(a))の全体をマイクロ CT モ ードで測定した(図4(b)).次に、マイクロ CT データから 内部亀裂の位置を特定した(図4(b)の丸で囲んだ部分).最 後に、特定した内部領域をナノ CT モードで非破壊的に観察 した(図4(c)). (α + β)二相微細構造と初期クラックの3次 元的な位置関係が明確に観察できる.また、試験機で追加の 負荷をかけることによって、内部亀裂の伝播過程の精細な追 跡も可能となった(図4(d)).

(2) 高エネルギー計測と高精細化

大型の試料、あるいは適当なサイズであっても高密度物質 で構成される試料の内部構造を非破壊で可視化しようとした 場合,その試料に対して十分なX線透過率を得るために は、高エネルギー領域のX線が必要となるということは周 知の通りである.なお、本項での高エネルギー領域とは、概 ね100 keV 以上を差すこととする. そのため, 高エネルギ ーX線マイクロCTでは、鉄や銅といった標準的な金属材 料から構成された試料や化石試料などが主なターゲットとし て挙げられる. 高エネルギーX線という点に限定すれば, 産業用・工業用 CT 装置など,放射光施設で利用可能な X 線エネルギーよりもはるかに高いエネルギーによる測定も可 能であるが(15)、ミクロンオーダーの空間分解能における計 測,あるいはX線ビームの空間コヒーレンスを活かした屈 折コントラストを用いた高コントラスト測定などは、放射光 ベースの高エネルギーX線画像計測が得意とするところと いえる.一方で,X線エネルギーに依らず,試料内部構造 を包括的かつ詳細に観察したいというニーズは昔からあり, "高精細画像計測"という計測技術の成熟を待つ必要があっ た.近年科学計測における高精細 CMOS カメラの実用化に より,X線画像計測の高精細化を本格的に進める時期に来 ていると考えられる.本稿で取り上げる高エネルギーX線 マイクロCTの場合,幸いなことに,測定ターゲットは上記 のように大型化する傾向があるため、高精細画像計測を組み 合わせることで、内部構造を広く・細かく可視化する技術と して相性が良い. ここでは, SPring-8 における高エネルギ ーX線マイクロCTの最近のアップデートと、それに高精 細カメラを組み合わせた測定の現状について紹介する.

まず,放射光施設における高エネルギーX線ビームの効率的利用に関して述べる.画像計測に限らず,放射光X線を用いた計測の場合,一般的には分光器で単色化されたX線が用いられる.特に,ある元素の吸収端近傍における測定や,フレネルゾーンプレートといった回折型の光学素子を用いた測定の場合,分光器を通して得られる単色性の高いX線の有用性は言うまでもない.その一方で,高エネルギー領域のX線画像計測では,必ずしも高い単色性が必要となるわけではなく,むしろ積分強度が重要視される画像計測においては,エネルギー分解能に優れた分光器から得られる単色





X線では、必要以上に単色性が上がり、かえって非効率的 となる. また, SPring-8のような大型放射光施設といえ ど,高エネルギー領域のX線強度は低下していくため,効 率の良い高エネルギーX線画像計測のためには、エネルギ ーバンド幅の広い X線ビームの利用が適切といえる.そこ で、最近の高エネルギー X線画像計測では、放射光偏向電 磁石光源から得られる白色X線に着目して、その高エネル ギー領域成分を広いエネルギーバンド幅で利用する計測技術 開発の推進している.分光器を使わずに,高エネルギー領域 のX線を取り出すには,適当な材質・厚みのアブソーバー を用いて、低エネルギー成分を除去する方法が最も簡便であ る. ここでは, 適当なアブソーバーを用いて, 高エネルギー X線を取り出す方法を紹介する.SPring-8の偏向電磁石か ら得られる白色X線に対して、タングステン厚さ0.5mm と鉛厚さ2mm を組み合わせたアブソーバーを用いることに より, ピークエネルギー約200 keV, エネルギーバンド幅 100 keV 程度の高エネルギー白色 X 線スペクトルを得るこ とができる⁽¹⁶⁾.アブソーバー自身には、白色X線照射によ り強い熱負荷がかかるため、空冷をするとともに、光源側に タングステンを配置することにより、鉛への熱負荷を軽減 し、その変性を防いでいる.また、アブソーバー自身の透過 強度ムラに伴う、透過投影像および CT 再構成像への影響を 低減させるために,X線ビームに直交する面内でアブソー バーを 1500~2000 rpm で回転させている.

SPring-8 では,偏向電磁石ビームライン BL28B2 におい て,白色 X 線を用いた高エネルギー X 線マイクロ CT を行 うことが可能である.測定光学系の概要を図5に示す. BL28B2 は,計測に利用できるハッチが2つあり,光源に近 い上流側の光学ハッチ2に試料ステージを設置し,下流側 の光学ハッチ3に X 線画像検出器を設置している.なお,

高エネルギー領域のX線を取り出すためのアブソーバーお よび高エネルギーX線用シャッターは光学ハッチ1の最下 流部分に設置している. 高エネルギーX線用シャッター は、ロータリーソレノイドにより簡便に開閉を行うことが可 能である.シャッターの開閉スピードはともに80ミリ秒以 下である.X線画像検出器は,他の放射光X線画像計測同 様に、シンチレータによる可視光変換型の画像検出器であ り、実効画素サイズ数ミクロン以上の計測に対応するため、 タンデムレンズ系を用いた可視光光学系を採用している.し かし,高エネルギー領域のX線では,厚いシンチレータを 容易に透過してしまうため、可視光光学系の配置に注意が必 要となる.また、高分解能測定のためには、実効画素サイズ に対する可視光光学系の光学的性質(シンチレータ厚みと実 効的な焦点深度の関係など)も考慮する必要がある.視野幅 50 mm まで測定可能な高エネルギーX線画像計測専用に開 発した画像検出器では、シンチレータを透過したX線から の散乱の影響を低減させるために、水平面内において、X 線の光軸と直交するように可視光光学系の光軸を設定してい る⁽¹⁷⁾. 可視光光学系を介して画像を検出するカメラには, 高精細カメラを用いることで、広く・細かく撮影することが 可能となる. 高精細 CMOS カメラには、浜松ホトニクス社 製のC13949-50U(画素数4096(H)×3008(V), 画素サイズ 3.45 µm×3.45 µm, 12bit ADC) や Baumer 社製の VCXU-201M.R(画素数5472(H)×3648(V), 画素サイズ 2.4 µm× 2.4 µm, 12bit ADC)などが利用可能である. 使用するビー ムモニターやシンチレータ、可視光光学系の倍率を変えるこ とにより、広視野計測から高分解能計測まで対応することが 可能であり、計測条件例を挙げると、実効画素サイズ12.1 µm/pixel で視野幅 49.6 mm, 実効画素サイズ 3.99 µm/pixel で視野幅 16.3 mm といった測定が可能である. なお, 投



図5 BL28B2における高エネルギーX線マイクロCT装置の模式図と照射X線のスペクトル.(オンラインカラー)

特



図6 高エネルギーX線マイクロCT装置で撮影された石灰 岩の超高精細CT像.(オンラインカラー)

影像の縦方向の視野幅は、光源からの高エネルギーX線の 放射幅に依存しており, BL28B2 における X 線マイクロ CT 測定位置(光源から45m地点)における縦有効幅はおよそ 1.5 mm である. 画像1枚あたりの撮影にかかる露光時間は 概ね30ミリ秒程度であり、CT 撮影1回あたりの測定に要す る時間は5分前後である.ただし、上記のように、視野縦 幅の有効領域は 1.5 mm であるため, ボリュームデータの測 定のためには、試料を鉛直方向にステップ走査して、繰り返 し CT 測定を行う必要がある.測定例として,石灰岩の高エ ネルギーCT 像を図6に示す. 実効画素サイズは2.36 µm として、オフセットスキャン法を併用することにより、更な る高精細計測を行った.投影数は7200投影である.図6に 示した石灰岩の断層像は、10,549×10,549画素によって構成 されており,右上に示した四角で囲った領域の拡大像では, 直径 150 µm 程度の微小な含有物のスポーク状の構造も明瞭 に測定できている.

3. 4**D**-**CT**

放射光 X 線イメージングでは高い光東密度の X 線を利用 し、計測時間が短くできる.空間分解能(検出器の画素サイ ズ)や用いる X 線エネルギーにもよるが、最近では投影像1 枚当たりの露光時間が1ミリ秒以下となるケースも出てく るようになった⁽¹⁸⁾⁽¹⁹⁾.こうなると単純に時間分解能を持っ た CT 計測が可能となる.これは最近では 4D-CT と呼ばれ るようになってきた.放射光 X 線を利用した 4D-CT には一 っ大きな利点がある.X線の平行性が高く、試料と検出器 の距離をある程度長くとっても、画像検出器に写る像(特に サイズ)はそれほど変化しないことである.これにより、電



図7 BL20B2 におけるその場観察 CT 装置の様子.(オンライ ンカラー)

気炉や引張試験機など種々の材料試験機の設置が可能とな る⁽²⁰⁾⁽²¹⁾.また,観察する事象も多岐にわたる.前述の破壊 や変形などの不可逆変化が起こるような材料試験はもちろ ん,弾性変形のように繰り返しの動作が可能な事象や呼吸・ 心電同期を行った小動物の CT 撮影なども実施されてい る⁽²²⁾.不可逆変化の観察のためにはいかに試料を高速で回 転させるか,ということを考慮する必要がある.つまり,精 度良く回転するステージとその回転運動に耐えられる試料を 用いなければならない.現状では数 Hz(100ミリ秒より長い 時間分解能)程度の CT 像の撮影が一般ユーザーに供されて いるようである.一方で可逆変化である現象の観察はタイミ ングさえきちんと合わせれば,ミリ秒の時間分解能での計測 が十分可能である.

本項では、SPring-8 BL20B2で製作されたその場観察 CT 装置(神津精機製 SPU-12)の概要とそれを使った実験例を示 す⁽²³⁾. 図7は、実験装置の写真である.実験ハッチには、 試料ステージとX線画像検出器が設置されている.実験ハ ッチでは、幅20mm以上、高さ3mm以上の大きなビーム を使用することができる.試料位置での光束密度は、25 keVのX線で 1.5×10^9 photons mm⁻² s⁻¹程度である.今 回の実験は25 keV で行われたが、15 keV~37 keV の範囲 であれば問題なく利用可能である.

SPU-12では、数マイクロメートルの分解能(動作精度)を 実現している. 試料回転ステージの最高回転速度は毎秒20 度以上.上下にZステージを配置し、試料に一方向性の荷 重がかけられる.最大荷重は2kNである.上下の回転ステ ージを独立に動作させ、試料をねじることも可能である.

X線画像検出器は、ビームモニター AA60P(浜松ホトニ クス)と科学計測用 CMOS カメラ(ORCA Flash 4.0, 同社) で構成されている. ビームモニターは、薄膜蛍光面(厚さ 20 μ m の P43(Gd₂O₂S:Tb⁺)粉末)と可視光光学系(f=105 mm レンズ)で構成されている. カメラには f=50 mm のレンズ が搭載されており、その結果実効画素サイズは 13.2 μ m/ pixel となった. 画像のフォーマットは2048×2048, ADC



図8 SBR を引っ張りながら撮影した CT 像. 数字は撮影開始からの時間(秒)を表す. (a) (a) 各時刻の X 線透過画像. (b) サン プルの中心で仮想的に切断した X 線 CT 画像. (c) 2 本のピンの中間点での CT 画像. (オンラインカラー)

は16ビットである.測定中,試料ステージは一定の速度で 回転し続けている. パルスモーターコントローラ(PM16C-04-XDL, ツジ電子)から0.2度毎にカメラに対してトリガ信 号が出力される.この実験では、一方向荷重時の移動速度を 2µm/sec としたが, これは CT 1 回当たりの撮影時間(7.5 秒)に動く量を検出器の空間分解能以下にさせるためであ る. 試料はシリカ粒子(20 nm)を付着させたスチレン・ブタ ジエン・ゴム(SBR)で、厚さ1mmのSBR を金属棒の先端 に接着剤で貼り付けた.図8にこの装置で得られたX線画 像を示す. (a)(b)(c)はそれぞれ単純投影像, 試料の縦断層 像(試料中心部での virtual slice)および,SBR の中心位置で の CT 像となっている. (a) と(c)の図の横にある数値は測定 開始からの時間(秒)を表している.開始から200秒ほど経過 (引張の距離は 400 µm 程度)したころからボイドが発生し始 めた. 500秒を過ぎるころには、たくさんのボイドが発生し ていることがわかる. さらに CT 撮影中でも計測系の空間分 解能以下の変形は画質に影響しないこと、常にゆっくりと変 形させることで粘弾性体が緩和することを防げていることが 分かる.

X線CTのこれからの課題 —3D 画像処理および 画像解析—

X線CTは試料の透過像を画像再構成し断層像を作るまで が計測であると考えられる.つまり再構成画像(CT像)が生 データと言える.試料由来あるいは試料環境由来の計測の難 しさはあるが、サンプリング定理をはじめとする変換に対し ての基本式は確立しているし、最近ではGPGPUを利用し

た画像再構成ソフトも充実しており、ほぼストレートに実施 可能である.難しいのはここから先の処理である.例えばデ ータ量であるが、2048×2048画素のカメラを使った場合、 CT 像1枚当たり2048×2048画素になるので,16bit 画像で あれば8MB, これが2048枚重なると16GBとなる.これ が4096×3008画素のカメラを使うと96GBになる.これを データ取得用計算機から画像処理用計算機に転送するのに相 当な時間がかかる. さらに, 3D データから必要な情報を抽 出するためのノイズフィルター適用, Erosion-Dilation 処理 やセグメンテーションもかなりの計算機資源を必要とする. また,通常CT撮影は1回で終わることはなく,一般的なケ ースでも1日に50-60スキャン行うことはザラであり、撮影 を進めながら前述の処理を遅滞なく進めることは難しい. つ まり、これらを高速かつ自動で処理するような仕組みが必要 とされるようになってきた. 機械学習を利用したノイズ除去 やセグメンテーションの研究も精力的に進められているが、 個々の研究事例に対する適用はできているものの、ユニバー サルに適用できるようなものはまだ登場しておらず, 試料タ イプや条件に応じて何度も学習をやり直す必要がある.計算 能力の向上や転送速度の向上を含めたハードウエアの進化も 重要だが、新しいアルゴリズムを利用した画像処理のソフト ウエアが登場することを期待したい.

5. おわりに

本稿では SPring-8 における放射光 X 線 CT の最近の進展 を中心に記述した. X 線 CT は世界中の放射光施設で開発・ 利用されておりその成果はめざましい. ラボ用の CT 装置も

集

非常に高いレベルに到達しており,今後の発展も期待でき る.さらに,中性子線CT,TEM-CT,MRIなどといった イメージング技術が進歩しており,それらの情報が相互に参 照できるのが理想的であろう.それらの技術を結ぶのは,装 置の利用者諸氏および新しい発想に基づいたソフトウェア開 発者である.これからの連携強化に期待したい.

文 献

- (1) G. N. Hounsfield: Br. J. Radiology, 46(1973), 1016–1022.
- (2) https://www.bruker.com/ja/products-and-solutions/ microscopes/3d-x-ray-microscopes/skyscan-1272.html (2021.11.25現在)
- (3) https://www.zeiss.com/microscopy/int/products/x-raymicroscopy.html(2021.11.25現在)
- (4) https://japan.rigaku.com/ja/products/xrm(2021.11.25現在)
- (5) M. Ge, D. S. Coburn, E. Nazaretski, W. Xu, K. Gofron, H. Xu,
 Z. Yin and W. K. Lee: Applied Physics Letters, 113(2018), 083109.
- (6) G. Martínez-Criado, J. Villanova, R. Tucoulou, D. Salomon, J.-P. Suuronen, S. Labouré, C. Guilloud, V. Valls, R. Barrett, E. Gagliardini, Y. Dabin, R. Baker, S. Bohic, C. Cohen and J. Morse: J Synchrotron Radiat, 23 (2016), 344–352.
- (7) V. De Andrade, A. Deriy, M. Wojcik, D. Gürsoy, D. Shu, T. Mooney, K. M. Peterson, A. Glowacki, K. Yue, X. Yang, R. Vescovi and F. D. Carlo: Proc. SPIE, **9967**(2016), 99670H.
- (8) A. A. MacDowell, D. Y. Parkinson, A. Haboub, E. Schaible, J. R. Nasiatka, C. A. Yee, J. R. Jameson, J. B. Ajo-Franklin, C. R. Brodersen and A. J. McElrone: Proc. SPIE, 8506(2012), 850618.
- (9) M. Stampanoni, A. Groso, A. Isenegger, G. Mikuljan, Q. Chen, D. Meister, M. Lange, R. Betemps, S. Henein and R. Abela: AIP Conference Proceedings, 879(2007), 848.
- (10) A. Takeuchi and Y. Suzuki: Microscopy, **69**(2020), 259–279.
- (11) A. Takeuchi, K. Uesugi, M. Uesugi, H. Toda, K. Hirayama, K. Shimizu, K. Matsuo and T. Nakamura: Rev. Sci. Instrum, 92 (2021), 023701.
- (12) A. Takeuchi, K. Uesugi, M. Uesugi, F. Yoshinaka and T. Nakamura: Microsc. Microanal, 24(2018), 106–107.
- (13) A. Tsuchiyama, M. Uesugi, T. Matsushima, T. Michikami, T. Kadono, T. Nakamura, K. Uesugi, T. Nakano, S A. Sandford, R. Noguchi, T. Matsumoto, J. Matsuno, T. Nagano, Y. Imai, A. Takeuchi, *et al.*: Science, **333**(2011), 1125–1128.

- (14) F. Yoshinaka, T. Nakamura, S. Nakayama, D. Shiozawa, Y. Nakai and K. Uesugi: Int. J. Fatigue, 93(2016), 397–405.
- (15) 例えば東芝 IT コントロールシステム株式会社(https://www. toshiba-itc.com/hihakai/toscaner-20000/),株式会社ニコンソ リューションズ(https://www.nsl.nikon.com/jpn/industrialproducts/xray-ct-inspection/ct/xt-h-450), YXLON International (https://www.yxlon.co.jp/ja/products/x-ray-and-ctinspection-systems/yxlon-ct-compact-ja)(2021.11.25現在)
- (16) M. Hoshino, K. Uesugi, R. Shikaku and N. Yagi: AIP Advances, 7(2017), 105122.
- (17) M. Hoshino, K. Uesugi and N. Yagi: J. Synchrotron Rad, 27 (2020), 934–940.
- (18) E. Maire, C. L. Bourlot, J. Adrien, A. Mortensen and R. Mokso: Int J Fract, 200 (2016), 3–12.
- (19) M. P Olbinado, V. Cantelli, O. Mathon, S. Pascarelli, J. Grenzer, A. Pelka, M. Roedel, I. Prencipe, A. L. Garcia, U. Helbig, D. Kraus, U. Schramm, T. Cowan, M. Scheel, P. Pradel, *et al.*: J. Phys. D: Appl. Phys., **51** (2018), 055601
- (20) H. Toda, H. Oogo, K. Horikawa, K. Uesugi, A. Takeuchi, Y. Suzuki, M. Nakazawa, Y. Aoki and M. Kobayashi: Metall. Trans. A: 45 (2014), 765–776.
- (21) S. Okumura, M. Nakamura, K. Uesugi, T. Nakano and T. Fujioka: Earth and Planetary Science Letters, 362(2013), 163– 170.
- (22) T. Sera, K. Uesugi, R. Himeno and N. Yagi: Respiratory Physiology & Neurobiology, 156 (2007), 304–311.
- (23) K. Uesugi, M. Hoshinio, H. Kishimoto and R. Mashita: Proc. SPIE, 9967 (2016), 99670V.

2000年3月 東京工業大学大学院理工学研究科博士課程中退

2000年4月 財団法人 高輝度光科学研究センター 放射光研究所 研究員 2017年10月 公益財団法人 高輝度光科学研究センター 主席研究員(現職) 専門分野:X線マイクロCT とその応用

◎SPring-8 にてビームライン担当者として活動. X 線 CT 装置および X 線画 像検出器の開発に従事.



上杉健太朗



星野真人



竹内晃久